

貴重儀器設備管理人情形：

設備管理人	設備	減免方式(每台設備)	備註	依據
李伯軒教授	1. 金屬 3D 列印機(工 EV1012) 2. 雷射切割機(工 EV1013) 3. 線切割機(2 台-工 EV1013)(1 台-工 EN1028)	20 小時/每周	自 112 年 11 月起	112 學年度第 2 次
黃永茂教授	沖床(鍛壓機)(工 EV1011)	20 小時/每周	自 112 年 11 月起	112 學年度第 2 次
胡龍豪教授	表面粗度輪廓形狀量測儀(工 EN1027)	20 小時/每周	自 112 年 11 月起	112 學年度第 2 次
蔡尚南教授	線切割機 (工 EN1028)	20 小時/每周	自 112 年 11 月起	112 學年度第 2 次
蔡尚南教授	沖床(鍛壓機)(工 EV1011)	20 小時/每周	自 112 年 11 月起 114 年 12 月 9 日止	112 學年度第 2 次 114 學年度第 1 次
王郁仁教授	亞歲五軸 CNC 銑床(工 EN1027)	20 小時/每周	自 112 年 11 月起	112 學年度第 2 次
汪正祺教授	東台五軸 CNC 銑床(工 EN1027)	20 小時/每周	自 113 年 3 月起	112 學年度第 5 次
汪正祺教授	東台車銑複合機(工 EN1027)	20 小時/每周	自 113 年 5 月起	112 學年度第 6 次
李伯軒教授	掃描式電子顯微鏡(工二大樓頂樓)	20 小時/每周	自 113 年 6 月起	112 學年度第 7 次
蔡尚南教授	掃描式電子顯微鏡(工二大樓頂樓)	20 小時/每周	自 113 年 6 月起	112 學年度第 7 次
盧威廷教授	臥式 CNC 銑床(工 EV1011)	20 小時/每周	自 114 年 7 月起。	113 學年度第 3 次

113 學年度第 1 次儀器設備暨空間委員會議

工 EN1026 實驗室分區管理人

說明：

1. 依 113 年 5 月 15 日 112-6 系儀器設備暨空間委員會議紀錄，本系工 EN1026 實驗室，可區隔為黃光室、白光室及微質點影像觀測設備室，擬委託有相關研究的教師分區管理(先徵得相關教師同意後，經本會審議同意後公告)，重要設備使用需要登記及紀錄等手續，教學用途之耗材由系辦負擔，教師研究之耗材由教師負擔。原微熱傳增強研究室研究生可繼續使用設備至畢業。
2. 目前洽詢有相關研究的教師如下表，請審議是否同意委託分區管理，如獲同意後，將會公告

於系網頁後，開始實施。

場地	申請 管理人	重要設備
黃光室	胡龍豪	三眼工具顯微鏡 特殊汞燈設備 曝光機週邊設備 曝光機 無塵排煙櫃
白光室	楊政融	濺鍍機專用冰水機 濺鍍腔體 質子交換膜測試平台 鋁線鋸線機 高真空濺鍍機系統 高真空濺鍍機專用前處理槽 特製多層膜濺鍍系統 4吋旋轉實驗型銅電鑄槽設備 微小型直接甲醇燃料電池組測試系統 微型質子交換膜燃料電池燃料供應與測試系統 恒電位儀設備 氣體分析儀 表面輪廓機 膜電極熱壓設備 質子交換膜燃料電池系統
微質點影像 觀測設備室	郭清德	高速影相處理工作站 影像觀測儀 高速攝影機 高速攝影機模組 微質點影像觀測設備 高速影像感 應擷取系統 全內反射光學路徑精密調整組 高速螢光單分子通道記錄分析系統 顯微螢光濾鏡組 全內反射系統調焦光學平台 螢光顯微鏡組件 脈衝式雷射激光器 粒子影像干涉儀之零組件 紅外線影像儀 紅外線熱影像分析儀 微質點影像測速儀